（導管）第5表　ガス製造設備計画

P万里ガス株式会社

造所名：本社工場

【ガス発生設備】

	設備名	原料名			28年度（実績）	29年度（実績見込）	30年度（初年度）	31年度	32年度	33年度	34年度
年度末ガス発生設備計画	気化装置	LNG	基数	基	2	2	2	2	2	2	2
			ガス発生能力	㎥／時	990	990	990	990	990	990	990
	気化装置	LPG	基数	基	2	2	2	2	2	2	2
			ガス発生能力	㎥／時	40	40	40	40	40	40	40
	合　計		基数	基	4	4	4	4	4	4	4
			ガス発生能力	㎥／時	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030

〈ガス発生設備の設置等計画〉

年度	設備名	原料名	基数	供給ガスの種類	能力（㎥／時）	工事の着手予定年月日	使用開始予定年月	設・改休・廃

【原燃料貯蔵設備】

	原料名			28年度（実績）	29年度（実績見込）	30年度（初年度）	31年度	32年度	33年度	34年度
年度末原燃料貯蔵設備計画	液化天然ガス	基数	基	1	1	1	1	1	1	1
		容量	kl	100	100	100	100	100	100	100
	液化石油ガス	基数	基	1	1	1	1	1	1	1
		容量	kl	47	47	47	47	47	47	47
		基数	基							
		容量	kl							

〈原燃料貯蔵設備の設置等計画〉

年度	設備名	原料名	基数	供給ガスの種類	容量（kl）	工事の着手予定年月日	使用開始予定年月	設・改休・廃

【ガスホルダー】

			28年度（実績）	29年度（実績見込）	30年度（初年度）	31年度	32年度	33年度	34年度
年度末ガスホルダー計画	基数	基	1	1	1	1	1	1	1
	貯蔵容量	㎥	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000

〈ガスホルダーの設置等計画〉

年度	種類	基数	貯蔵容量（㎥）	圧力（高中低）	工事の着手予定年月日	使用開始予定年月	設・改休・廃